

薄膜技術に関する 研究助成募集

研究 領域

薄膜・表面・界面に関する研究分野で、
下記の4領域を優先する

- ①材料科学
- ②ライフサイエンス
- ③環境・エネルギー工学
- ④プラズマ工学



助成金額 及び件数

1件**200万円** (7件程度)

応募 資格

- (1)大学等高等教育機関、公的研究機関に属する者。
- (2)所属長の推薦があり、所属機関長の承認を得ていること。
- (3)募集期間締切時の年齢が、45歳以下の若手研究者。

募集 期間

2025年2月1日(土)～3月15日(土) **必着**

【選考結果は2025年7月末までに通知予定】

応募 方法

財団所定の「研究助成申請書」を郵送及び
E-mailの添付書類として申請してください。

募集要項・申請書類はこちらから▶www.samco.co.jp/foundation

